PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-114815

(43)Date of publication of application: 06.05.1998

(51)Int.CI.

COSG 59/24 COSG 59/20 CO8G 59/62 CO8K 3/36 CO8L 63/00 H01L 23/29 H01L 23/31

(21)Application number: 08-289213

(71)Applicant: TOSHIBA CHEM CORP

(22)Date of filing:

11.10.1996

(72)Inventor: HOSOKAWA HARLIOMI

(54) EPOXY RESIN COMPOSITION AND SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an epoxy resin compsn. excellent in moisture resistance by mixing an anthracene-type epoxy resin represented by a specific formula, a phenol resin, an epoxidized silane coupling agent, a crystal silica powder, and a cure accelerator. SOLUTION: Crystal silica powder (20-90wt.%) having a max. particle size of 150μm or lower is charged into a mixer, and a silane coupling agent represented by formula I (wherein R5 is an epoxidized group; R6 is methyl or ethyl; and (n) is 0, 1, or higher) and a base (e.g. diethylamine) in an amt. of 0.05-5wt.% of the coupling agent are added to the silica powder under stirring to treat the surface of the powder. The surface-treated silica powder is mixed with an anthracene-type epoxy resin represented by formula II (wherein R1 to R4 are each CnH2n+1; and (m) is 0, 1, or higher), a biphenyltype epoxy resin, a phenol resin having at least two epoxy-reactive hydroxyl groups, 0.01-5wt.% cure accelerator (e.g. triphenylphosphine), and additives such

 $\mathbf{R}^s = \mathbf{C}_{\mathbf{Y}} \oplus \Xi_{\mathbf{Y}} - \mathbf{S}_{\mathbf{T}} \oplus (\mathbf{C}_{\mathbf{T}}\mathbf{R}^{\mathbf{T}})$

П

1

as a mold release agent, a flame retardant, and a colorant at normal temp., kneaded at 70-100° C, cooled, and ground to give an epoxy resin compsn.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-114815

(43)公開日 平成10年(1998)5月6日

(E1) Y-4 C1 6	30h nzi ⇒1 p							
(51) Int.CI. ⁶	識別記号		FΙ					
CO 8 G 59/2			C08G					
59/2				59/20				
59/6	2			59/62				
C08K 3/3	6		C08K	3/36				
CO8L 63/0	0		C08L	63/00		В		
		審査請求	未請求 請求		FD	(全 6 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号	特願平8-289213		(71) 出顧人 390022415					
				東芝ケ	ミカル	株式会社		
(22)出顧日	平成8年(1996)10月11日		東京都港区新橋3丁目3番9号					
			(72)発明者 細川 晴臣					
				埼玉県	川口市	領家 5 丁目14	番25号 東芝ケ	
						社川口工場内		
			(74)代理力					
			(142)	• 71.44.44	PH P-1	_		

(54)【発明の名称】 エポキシ樹脂組成物および半導体封止装置

(57)【要約】

【課題】 半田浴浸漬後の耐湿性、半田耐熱性、成形 性、流動性に優れ、封止樹脂と半導体チップあるいはリ ードフレームとの間の剥がれや内部クラックの発生がな く、また電極腐蝕による断線や水分によるリーク電流発 生もなく、長期信頼性を保証できるエポキシ樹脂組成物 および半導体封止装置を提供する。

【解決手段】 (A) アントラセン型エポキシ樹脂、

- (B) フェノール樹脂、(C) エポキシ基を含有するシ ランカップリング剤、(D)結晶シリカ粉末および
- (E) 硬化促進剤を必須成分とし、全体の樹脂組成物に 対して前記(D)の結晶シリカ粉末を25~90重量%の割 合で含有してなるエポキシ樹脂組成物であり、また、こ のエポキシ樹脂組成物の硬化物によって、半導体チップ を封止した半導体封止装置である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 次の一般式に示されるアントラセ

対に示されるアントラセ 【化1】 CH_2-CHCH_2 OH_2 $CH-CH_2$ OH_3 OH_4 OH_4 OH_5 OH_5

(但し、式中、 $R^1 \sim R^4$ は同一又はたがいに異なるC

- m H2m+1 基を、m は0 又は1 以上の整数を表す)
- (B) フェノール樹脂、
- (C)次の一般式で示されるエポキシ基を有するシラン 10 カップリング剤、

【化2】 R⁵ - C_n H_{2n} - Si (OR⁶) 3

(但し、式中 R^5 はエポキシ基を有する原子団を、 R^6 はメチル基又はエチル基を、n は0 又は1 以上の整数をそれぞれ表す)

(D) 最大粒径が150 μm以下の結晶シリカ粉末および

2

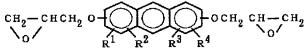
(E) 硬化促進剂

ン型エポキシ樹脂、

を必須成分とし、全体の樹脂組成物に対して前記(D)の結晶シリカ粉末を25~90重量%の割合で含有してなることを特徴とするエポキシ樹脂組成物。

【請求項2】 (A)次の一般式に示されるアントラセン型エポキシ樹脂、

【化3】



(但し、式中、 $R^1 \sim R^4$ は同一又はたがいに異なるC

- m H2m+1 基を、m は0 又は1 以上の整数を表す)
- (B)フェノール樹脂、
- (C) 次の一般式で示されるエポキシ基を有するシラン カップリング剤、

【化4】 $R^5 - C_n H_{2n} - S_i (OR^6)$ 3

(但し、式中 R^5 はエポキシ基を有する原子団を、 R^6 はメチル基又はエチル基を、n は0 又は1 以上の整数をそれぞれ表す)

- (D) 最大粒径が150 μm以下の結晶シリカ粉末および
- (E) 硬化促進剤

を必須成分とし、全体の樹脂組成物に対して前記(D) の結晶シリカ粉末を25~90重量%の割合で含有したエポキシ樹脂組成物の硬化物によって、半導体チップが封止 されてなることを特徴とする半導体封止装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、耐湿性、半田耐熱性、成形性に優れたエポキシ樹脂組成物および半導体封止装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体集積回路の分野において、 高集積化、高信頼性化の技術開発と同時に半導体装置の 実装工程の自動化が推進されている。例えばフラットパッケージ型の半導体装置を回路基板に取り付ける場合 に、従来、リードピン毎に半田付けを行っていたが、最 近では半田浸漬方式や半田リフロー方式が採用されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来のノボラック型エポキシ樹脂等のエポキシ樹脂、ノボラック型フェノール 50

樹脂および無機充填剤からなる樹脂組成物によって封止した半導体装置は、装置全体の半田浴浸漬を行うと耐湿性が低下するという欠点があった。特に吸湿した半導体装置を浸漬すると、封止樹脂と半導体チップ、あるいは封止樹脂とリードフレームとの間の剥がれや、内部樹脂クラックが生じて著しい耐湿性劣化を起こし、電極の腐蝕による断線や水分によるリーク電流を生じ、その結果、半導体装置は、長期間の信頼性を保証することができないという欠点があった。

【0004】また、よく使用されている下記に示したナフタレン骨格含有エポキシ樹脂は、

[0005]

【化5】

従来のノボラック型エポキシ樹脂やビフェニル型エポキシ樹脂に比較すると、靭性値が高いという長所があるもののエポキシ当量が低く、これを用いた樹脂組成物を低吸湿化することが困難であった。

【0006】本発明は、上記の欠点を解消するためになされたもので、吸湿の影響が少なく、特に半田浴浸漬後の耐湿性、半田耐熱性、成形性、流動性に優れ、封止樹脂と半導体チップあるいは封止樹脂とリードフレームとの間の剥がれや、内部樹脂クラックの発生がなく、また電極の腐蝕による断線や水分によるリーク電流の発生もなく、長期信頼性を保証できるエポキシ樹脂組成物および半導体封止装置を提供しようとするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記の目的 を達成しようと鋭意研究を重ねた結果、特定のエポキシ 3

樹脂、特定のシランカップリング剤を用いることによっ て、耐湿性、半田耐熱性、成形性等に優れた樹脂組成物 が得られることを見いだし、本発明を完成したものであ る。

【0008】即ち、本発明は、

(A) 次の一般式に示されるアントラセン型エポキシ樹

$$\underbrace{\operatorname{ch}_2 - \operatorname{chch}_2 \circ \underbrace{\operatorname{ch}_{\operatorname{R}^2} \circ \operatorname{ch}_2}_{\operatorname{R}^1} \circ \operatorname{ch}_2 \circ$$

(但し、式中、 $R^1 \sim R^4$ は同一又はたがいに異なる Cm H2m+1 基を、m は0 又は1 以上の整数を表す)

- (B) フェノール樹脂、
- (C) 次の一般式で示されるエポキシ基を有するシラン カップリング剤、

[0010]

【化7】 R⁵ - C_n H_{2n} - Si (OR⁶)₃

(但し、式中R5 はエポキシ基を有する原子団を、R6 はメチル基又はエチル基を、n は0 又は1 以上の整数を それぞれ表す)

- (D) 最大粒径が150 μm以下の結晶シリカ粉末および 20
- (E) 硬化促進剤

を必須成分とし、全体の樹脂組成物に対して前記 (D) の結晶シリカ粉末を25~90重量%の割合で含有してなる ことを特徴とするエポキシ樹脂組成物である。また、こ のエポキシ樹脂組成物の硬化物によって、半導体チップ が封止されてなることを特徴とする半導体封止装置であ る。

【0011】以下、本発明を詳細に説明する。

【0012】本発明に用いる(A)エポキシ樹脂は、前 記の一般式化6で示されるものが使用される。具体的な 化合物としては、例えば

[0013]

[化8] CH2-CHCH2 O-OCH2 CH-CH2

が挙げられる。また、このエポキシ樹脂には、ノボラッ ク系エポキシ樹脂、エピビス系エポキシ樹脂、ビフェニ ル型エポキシ樹脂その他の一般の公知のエポキシ樹脂を 併用することができる。

【0014】本発明に用いる(B)フェノール樹脂とし ては、前記(A)のエポキシ樹脂のエポキシ基と反応し 得るフェノール性水酸基を2 個以上有するものであれば 特に制限するものではない。具体的な化合物として例え ぼ

[0015]

[(E9]

(但し、n は0 又は1 以上の整数を表す) [0016]

【化10】

(但し、n は0 又は1 以上の整数を表す)

[0017] 【化11】 ОH

(但し、n は0 又は1 以上の整数を表す)

[0018]

【化12】

$$\bigcirc H \bigcirc C + 3 \bigcirc C + 3$$

(但し、n は0 又は1 以上の整数を表す)

[0 0 1 9] [化 1 3] OH OH OH OH

(但し、n は0 又は1 以上の整数を表す)等が挙げられ、これらは単独又は混合して使用することができる。【0020】本発明に用いる(C)エポキシ基を有するシランカップリング剤としては、前記の一般式化7で示 20されるものが使用される。具体的なものとして、例えば、

等が挙げられ、これらは単独又は混合して使用すること ができる。

【0023】このシランカップリング剤には極微量の有機塩基を添加処理することができる。有機塩基で処理することによって加水分解性を高めることができ、ここで添加処理する有機塩基としてジメチルアミン、ジエチルアミン、ピリジン、キノリン、ピペリジン等の環状有機塩基を挙げることができ、これらは単独又は混合して使用することができる。有機塩基の配合割合は、シランカップリング剤に対して0.05~5 重量%の範囲内で使用することが望ましい。この配合量が0.05重量%未満ではシランカップリング剤の加水分解を十分に促進することができず、また、5 重量%を超えると耐湿信頼性が低下して好ましくない。

【0024】本発明に用いる(D)結晶シリカ粉末としては、不純物濃度が低く最大粒径が $150~\mu$ m以下で、平均粒径 $30~\mu$ m以下の結晶シリカ粉末が好ましく使用される。平均粒径 $30~\mu$ mを超えると耐湿性および成形性が劣り好ましくない。結晶シリカ粉末の配合割合は、全体の 50

樹脂組成物に対して25~90重量%含有するように配合することか好ましい。その割合が25重量%未満では樹脂組成物の吸湿性が高く、半田浸漬後の耐湿性に劣り、また90重量%を超えると極端に流動性が悪くなり、成形性に劣り好ましくない。これらの結晶シリカ粉末に、シランカップリング剤に有機塩基を添加し、直ちにヘンシェルミキサー、スーパーミキサー等で処理を行うと均一に表面処理ができ、その効果が十分に発揮できる。

6

【0025】本発明に用いる(E)硬化促進剤として は、リン系硬化促進剤、イミダゾール系硬化促進剤、D BU系硬化促進剤その他の硬化促進剤等を広く使用する ことができる。これらは単独又は2種以上併用すること ができる。硬化促進剤の配合割合は、全体の樹脂組成物 に対して0.01~5 重量%含有するように配合することが 望ましい。その割合が0.01重量%未満では樹脂組成物の ゲルタイムが長く、硬化特性も悪くなり、また、5 重量 %を超えると極端に流動性が悪くなって成形性に劣り、 さらに電気特性も悪くなり耐湿性に劣り好ましくない。 【0026】本発明のエポキシ樹脂組成物は、前述した 特定のエポキシ樹脂、フェノール樹脂、特定のシランカ ップリング剤、結晶シリカ粉末および硬化促進剤を必須 成分とするが、本発明の目的に反しない限度において、 また必要に応じて、例えば天然ワックス類、合成ワック ス類、直鎖脂肪酸の金属塩、酸アミド類、エステル類、 パラフィン類等の離型剤、三酸化アンチモン等の難燃 剤、カーボンブラック等の着色剤、ゴム系やシリコーン 系の低応力付与剤等を適宜添加配合することができる。 【0027】本発明のエポキシ樹脂組成物を成形材料と

【0027】本発明のエポキシ樹脂組成物を成形材料として調製する場合の一般的方法は、前述した特定のエポキシ樹脂、フェノール樹脂、シランカップリング剤処理をした結晶シリカ粉末および硬化促進剤その他の成分を配合し、ミキサー等によって十分均一に混合した後、さらに熱ロールによる溶融混合処理またはニーダ等による混合処理を行い、次いで冷却固化させ適当な大きさに粉砕して成形材料とすることができる。こうして得られた成形材料は、半導体装置をはじめとする電子部品或いは電気部品の封止・被覆・絶縁等に適用すれば優れた特性と信頼性を付与させることができる。

【0028】また、本発明の半導体封止装置は、上述の成形材料を用いて半導体チップを封止することにより容易に製造することができる。封止を行う半導体チップとしては、例えば集積回路、大規模集積回路、トランジスタ、サイリスタ、ダイオード等で特に限定されるものではない。封止の最も一般的な方法としては、低圧トラン

7

スファー成形法があるが、射出成形、圧縮成形、注形等による封止も可能である。成形材料で封止後加熱して硬化させ、最終的にはこの硬化物によって封止された半導体封止装置が得られる。加熱による硬化は、150 ℃以上に加熱して硬化させることが望ましい。

【0029】本発明のエポキシ樹脂組成物および半導体 封止装置は、特定のエポキシ樹脂、フェノール樹脂、特 定のシランカップリング剤、結晶シリカ粉末および硬化 促進剤を用いることによって、樹脂組成物の吸水性を低 減し、成形性、流動性、熱機械的特性と低応力性が向上 し、半田浸漬、半田リフロー後の樹脂クラックの発生が なくなり、耐湿性劣化が少なくなるものである。

[0030]

【発明の実施の形態】次に本発明を実施例によって説明

テトラブロモビスフェノールA型エポキシ樹脂1.5 %、前述した化9のフェノール樹脂1.0 %、前述した化10のフェノール樹脂4.2 %、トリフェニルホスフィン0.2 %、カルナバワックス類0.4 %、カーボンブラック0.3 %、および三酸化アンチモン2.0 %を常温で混合し、さらに70~100 ℃で混練冷却した後、粉砕して成形材料(A)を製造した。

【0034】実施例2

結晶シリカ粉末(最大粒径150 μ m以下)84%をヘンシェルミキサーに入れ、攪拌しながら前述した化15のシ 30 ランカップリング剤0.4%と、ジエチルアミン 4×10^{-4} %とを加えて結晶シリカ粉末の表面処理をした。

【0035】次に前述した化8のアントラセン型エポキシ樹脂1.6%、実施例1で使用した化16のビフェニル型エポキシ樹脂4.5%、テトラブロモビスフェノールA型エポキシ樹脂1.5%、前述した化9のフェノール樹脂1.0%、前述した化11のフェノール樹脂4.2%、トリフェニルホスフィン0.2%、カルナバワックス類0.4%、カーボンブラック0.3%、および三酸化アンチモン2.0%を常温で混合し、さらに70~100℃で混練冷却し40た後、粉砕して成形材料(B)を製造した。

【0036】比較例1

結晶シリカ粉末(最大粒径150 μ m以下)84%をヘンシェルミキサーに入れ、攪拌しながら前述した化14 のシランカップリング剤0.4 %と、ジエチルアミン 4×10^{-4} %とを加えて結晶シリカ粉末の表面処理をした。

【0037】実施例1で使用した化16のビフェニル型 エポキシ樹脂6.1%、テトラブロモビスフェノールA型 エポキシ樹脂1.5%、化9のフェノール樹脂1.0%、前 するが、本発明はこれらの実施例によって限定されるものではない。以下の実施例および比較例において「%」とは「重量%」を意味する。

【0031】実施例1

結晶シリカ粉末(最大粒径150 μ m以下)84%をヘンシェルミキサーに入れ、攪拌しながら前述した化15のシランカップリング剤0.4%と、ジエチルアミン 4×10^{-4} %とを加えて結晶シリカ粉末の表面処理をした。

【0032】次に前述した化9のアントラセン型エポキシ樹脂1.6%、下記化16に示したビフェニル型エポキシ樹脂4.5%、

【0033】 【化16】

述した化10のフェノール樹脂4.2%、トリフェニルホスフィン0.2%、カルナバワックス類0.4%、カーボンブラック0.3%、および三酸化アンチモン2.0%を常温で混合し、さらに70~100℃で混練冷却した後、粉砕して成形材料(C)を製造した。

【0038】比較例2

結晶シリカ粉末(最大粒径150 μ m以下)84%をヘンシェルミキサーに入れ、攪拌しながら前述した化14のシランカップリング剤0.4%と、ジエチルアミン 4×10^{-4} %とを加えて結晶シリカ粉末の表面処理をした。

【0039】実施例1で使用した化16のビフェニル型エポキシ樹脂4.5%、テトラブロモビスフェノールA型エポキシ樹脂1.5%、化5に示したナフタレン型エポキシ樹脂1.6%、前述した化9のフェノール樹脂1.0%、前述した化11のフェノール樹脂4.2%、トリフェニルホスフィン0.2%、カルナバワックス類0.4%、カーボンブラック0.3%、および三酸化アンチモン2.0%を常温で混合し、さらに70~100℃で混練冷却した後、粉砕して成形材料(D)を製造した。

【0040】こうして製造した成形材料(A)~(D)を用いて 170℃に加熱した金型内にトランスファー注入、半導体チップを封止し硬化させて半導体封止装置を製造した。これらの半導体封止装置について、諸試験を行ったのでその結果を表 1 に示したが、本発明のエポキシ樹脂組成物および半導体封止装置は、耐湿性、半田耐熱性、成形性に優れており、本発明の顕著な効果を確認することができた。

[0041]

【表1】

50

10 **(単位)**

例	実力	在例	比較例	
特性	1	2	1	2
成形材料	A	В	С	D
曲げ強さ (kgf/m²) * 1	17.0	17.0	16.5	14.5
動膨弱感数 α1 (×10 5 /℃) * 2	1.9	1.9	1.9	2. 0

*1 : 175 \mathbb{C} , 80 k g / c m² , 2 分間のトランスファー成形をして成形品(試験片)をつくり、175 \mathbb{C} , 8 時間の後硬化を行い、J I S - K - 6 9 1 1 に準じて試験した。

吸水率 (ppm) * 3

半田耐熱性(不良数/試料数)* 4

*2 : *1 と同様な成形品を作り、175 ℃, 8 時間の後 硬化を行い、適当な大きさの試験片とし、熱機械分析装 置を用いて測定した。

*3 、*4 : 成形材料を用いて175 ℃, 2 分間トランスファー成形したTO-2 2 0 (9 ×14×4 mm) パッケ 20 ージを、175 ℃, 8 時間の後硬化を行った。こうして得た半導体封止装置を85℃, 85%, 48時間の吸湿処理した

後、増加した重量によって計算した。また、これを半田 浴浸漬($Max\ 260^{\circ}$)後、ハクリおよび口開きの有無 を調査した。

0/30 20/30

3000

[0042]

2100

0/30

2000

0/30

2200

【発明の効果】以上の説明および表1から明らかなように、本発明のエポキシ樹脂組成物および半導体封止装置は、耐湿性、半田耐熱性、成形性に優れ、吸湿による影響が少なく、電極の腐蝕による断線や水分によるリーク電流の発生等を著しく低減することができ、しかも長期間にわたって信頼性を保証することができる。

フロントページの続き

(51) Int.C1.6

識別記号

H 0 1 L 23/29 23/31 FΙ

HO1L 23/30

R